### (19) **日本国特許庁(JP)**

## (12) 公 表 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公表番号

特表2018-528082 (P2018-528082A)

(43) 公表日 平成30年9月27日(2018.9.27)

(51) Int. Cl.

B23K 26/342 テーマコード (参考)

4E168

B 2 3 K 26/342 (2014, 01) B23K 26/082 (2014.01)

B23K 26/082

FL

#### 審查請求 未請求 予備審查請求 未請求 (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願2018-527855 (P2018-527855) (86) (22) 出願日 平成28年8月13日 (2016.8.13) (85) 翻訳文提出日 平成30年4月9日(2018.4.9) (86) 国際出願番号 PCT/US2016/046941 (87) 国際公開番号 W02017/031015 (87) 国際公開日 平成29年2月23日 (2017.2.23)

(31) 優先権主張番号 62/205, 361

(32) 優先日 平成27年8月14日 (2015.8.14)

(33) 優先権主張国 米国(US) (71) 出願人 518051673

ディーエムスリーディー テクノロジ エ

ルエルシー

アメリカ合衆国 48326 ミシガン州 オーバーンヒルズ ポンティアックロー

**F2350** 

(74)代理人 100095407

弁理士 木村 満

(74)代理人 100109449

弁理士 毛受 隆典

(74) 代理人 100132883

弁理士 森川 泰司

(74)代理人 100148633

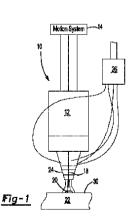
弁理士 桜田 圭

最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】直接材料堆積用レーザ走査ヘッドを備えるノズル

### (57)【要約】

基板上に直接材料堆積を行って三次元物体を生成する 装置は、ヘッドを動かす移動システムを含む。ヘッドは 、レーザビームを生成するためのレーザ装置と、レーザ ビームを基板に導いて基板上に溶融プールを生成するレ ーザスキャナとを含む。ノズルは、レーザビームによっ て生成された溶融プールに、材料を供給し、基板上に材 料ビードを生成する。レーザスキャナは、移動システム に協力可能であり、移動システムが第1経路に沿って動 けるのと同時にレーザスキャナは第2経路に沿って動け て、基板上に堆積された材料ビードを徐々に生成する。



【選択図】図1

#### 【特許請求の範囲】

### 【請求項1】

基板上への直接材料堆積を行う方法であって、

基板に向けてレーザビームを発射することによって溶融プールを生成するレーザスキャナを含むプロセスヘッドを提供すると共に、粉末材料を前記溶融プールに供給するノズルを提供するステップと、

前記プロセスヘッドを第1経路に沿って動かすために移動システムに前記プロセスヘッドを搭載するステップと、

前記移動システムを導いて前記第1経路に沿って動かすと共に、前記レーザスキャナを 導いて第2経路を辿らせるようにプログラム可能なコントローラを提供するステップであって、前記コントローラが、前記移動システムを導いて前記第1経路に沿って動かしなが ら前記レーザスキャナを導いて前記第2経路を辿らせることによって前記第2経路に沿っ て溶融プールを生成する、ステップと、

前記基板への直接材料堆積を行うために前記溶融プールに材料を供給するステップと、前記移動システムの動きを前記レーザスキャナと連動させるステップであって、前記溶融プールに供給された前記粉末材料から材料ビードを生成するために、前記移動システムが前記レーザスキャナを前記第 1 経路に沿って動かしながら前記レーザスキャナが前記第 2 経路を辿る、ステップと、

を備える、

方法。

#### 【請求項2】

所望の幾何学的形態を有する材料ビードを生成するために前記レーザスキャナの速度および前記粉末材料の注入速度を調整するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。

#### 【請求項3】

溶融プールを生成する前記ステップは、前記レーザスキャナが前記溶融プール内の所定 の経路に沿って前記レーザビームを動かすことを特徴とする、請求項 1 に記載の方法。

#### 【請求頃4】

レーザビームを発射する前記ステップは、ビーム直径を有するレーザビームを発射する ことを特徴とし、前記溶融プールを生成する前記ステップは、前記ビーム直径より大きい プール直径を有する溶融プールを生成することを特徴とする、請求項1に記載の方法。

#### 【請求項5】

レーザビームを発射することによって溶融プールを前記基板上に生成する前記ステップは、約 0 . 1 mm乃至 2 5 mmの直径を有する溶融プールを生成するために約 5 0 μ m乃至 5 0 0 μ mの直径を有するレーザビームを発射することを特徴とする、請求項 1 に記載の方法。

### 【請求項6】

レーザビームを発射することによって溶融プールを前記基板上に生成する前記ステップは、レーザビームの直径対溶融プールの直径の比率が約0.5乃至0.02であることを特徴とする、請求項1に記載の方法。

#### 【請求項7】

溶融プールを生成する前記ステップは、前記レーザスキャナが 5 m 毎秒乃至 2 0 m 毎秒の走査速度を有し、前記溶融プールが 0 . 1 m m 毎分乃至 5 m m 毎分の速度で進むことを特徴とする、請求項 1 に記載の方法。

### 【請求項8】

前記移動システムの動きを前記レーザスキャナと連動させる前記ステップは、前記レーザスキャナが前記第 2 経路を辿りながら前記移動システムが前記プロセスヘッドを前記第 1 経路に沿って同時に動かすことを特徴とする、請求項 1 に記載の方法。

### 【請求項9】

第 1 材料層を堆積すると共に、前記第 1 材料層の上に第 2 材料層を堆積するステップであって、前記第 1 材料層の堆積方向に対して直交する方向に前記第 2 材料層が堆積される

10

20

30

40

、ステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。

### 【請求項10】

前記レーザスキャナが前記第2経路を辿る前記ステップは、前記第2経路に沿って進む 前記ノズルによる動きとは独立に、前記レーザビームが前記第2経路に沿って進むことを 特徴とする、請求項1に記載の方法。

#### 【請求項11】

三次元物体を生成するために基板への直接材料堆積を行う装置であって、

移動システムと、

レーザビームを生成するレーザと、溶融プールを前記基板に生成するために前記レーザ ビームを前記基板上に導くレーザスキャナと、を含むヘッドと、

前記基板の上に材料ビードを生成するために前記レーザビームによって生成された前記 溶融プールに粉末材料を供給するノズルと、

を備え、

前記基板上に堆積した材料ビードを徐々に生成するために、前記レーザスキャナは前記 移 動 シ ス テ ム と 協 働 可 能 で あ り 、 前 記 移 動 シ ス テ ム が 第 1 経 路 に 沿 っ て 可 動 で あ り 、 同 時 に前記レーザスキャナが第2経路に沿って可動である、

装置。

### 【請求項12】

前記溶融プールに堆積した材料の複数の層から前記三次元物体を生成するために、前記 移動システムおよび前記レーザスキャナの動きを導くように、前記三次元物体のデジタル 版でプログラム可能なコントローラを含む、請求項1に記載の装置。

【請求項13】

前記移動システムは、第1速度で可動であり、前記レーザスキャナは、第2速度で可動 であり、前記第2速度は前記第1速度よりも大きい、請求項1に記載の装置。

#### 【請求項14】

前記レーザスキャナは、前記レーザビームのサイズおよび形状を調整するように構成さ れている、請求項1に記載の装置。

【請求項15】

前記レーザスキャナは、前記基板に前記溶融プールを生成しながら前記レーザビームの サイズおよび形状を調整するように構成されている、請求項1に記載の装置。

【請求項16】

前記レーザによって生成された前記レーザビームが、前記レーザスキャナによって前記 ノズルに対して可動である、請求項1に記載の装置。

【請求項17】

前記レーザによって生成された前記レーザビームは、約50μm乃至500μmの直径 を有する、請求項1に記載の装置。

【請求項18】

前記レーザは、約400ワットのレーザ出力を有する、請求項1に記載の装置。

【 請 求 項 1 9 】

前 記 レー ザ ス キ ャ ナ は 、 前 記 基 板 に 生 成 さ れ た 前 記 溶 融 プ ー ル 内 で 複 数 の 方 向 に 前 記 レ ーザビームを動かすように構成されている、請求項1に記載の装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

( 先行出願)

本願は、2015年8月14日付で出願された米国仮特許出願第62/205,361 号の優先権を主張する。

[0002]

(技術分野)

本発明は、概して、直接材料堆積を行うための、改善された方法および装置に係る。よ

10

20

30

40

10

20

30

40

50

り具体的には、本発明は、処理速度を向上し、かつ、エネルギー消費を削減するために、 直接材料堆積プロセスにおいてレーザスキャナを使用することに係る。

#### 【背景技術】

### [0003]

直接材料堆積が実用的な製造プロセスであることが判明している。直接材料堆積は、積層造形技術の一種であり、レーザを用いて溶融プールを金属基板上に生成し、そこに粉末またはワイヤを堆積させ、冷却して幾何学的形態を有する加工物に変化させる。現在は、溶融プールの所望のサイズに近い、大きなサイズのレーザスポットが使用されている。レーザスポットのサイズが増大するにつれて、溶融プールの生成に必要な熱を提供するためにより大きい電力消費が必要となる。例えば、レーザへの入力電力が6乃至8kWを超えて、例えば3mm×15mmの長方形の溶融プールを生成することは珍しくない。加えて、例えば、正方形、長方形および楕円形などの、異なる構成の溶融プールを生成するにあたって、付属する光学系に複雑な調整を行うことが必要となるという問題があることが判明している。

### [0004]

これらの制限の結果として、大型の構成要素を製造するために直接材料堆積を使用することが非常に高価であることが証明されており、したがって多くの場合には商業的に実行不可能である。したがって、費用対効果が高い方法と、低減された電力要求で、大型加工物の製造を可能とする直接材料堆積プロセスを開発することが望ましい。

### 【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

#### [0005]

基板上に直接材料堆積を行う方法は、レーザビームを照射するレーザスキャナを有するプロセスヘッドを使用することを含む。このレーザビームは、レーザスキャナによって基板上に溶融プールを生成するように導かれる。ノズルが、レーザビームによって生成された溶融プールに、材料を供給する。プロセスヘッドは、このプロセスヘッドを第1経路に沿って動かす移動システムに搭載されている。移動システムを導いて第1経路に沿ってずし、かつ、レーザスキャナを導いてレーザビームで第2経路を辿らせるようにプログラム可能なコントローラが提供されている。このコントローラは、同時にレーザスキャナを導いて第2経路を辿らせながら、移動システムを導いて第1経路に沿って動かして、第2経路に沿って溶融プールを生成する。材料が溶融プールに供給されて、直接材料堆積によって材料ビードが基板上に生成される。

#### [0006]

移動システムがプロセスヘッドを動かすのと同時に、第2経路を辿るレーザが、溶融プールに供給された粉末材料から材料ビードを生成するように、移動システムおよびレーザスキャナの動きは連動されている。レーザスキャナの速度と、材料ビードを生成するために使用される粉末材料の注入速度は、基板上の材料の所望の幾何学的形態を生成するように調整されている。

### [0007]

移動システムおよびノズルとの組み合わせでレーザスキャナを使用することで、直接材料堆積プロセスが大幅に強化される。レーザスキャナは、移動システムがプロセスヘッドを第1経路に沿って動かすのと同時に、溶融プールの所望のフットプリントを辿るレーザビームに迅速な動きを提供する。細いレーザビームを基板上に集束させて所望の溶融プールを生成するレーザスキャナを用いることによって、レーザの出力要求を、現在の出力要求である6乃至8キロワットから、400ワットに低減させられると考えられている。さらに、レーザスキャナは、レンズその他を交換するなどしてプロセスヘッドを変更する必要性も無いまま、異なる形状の溶融プールを基板上に生成する能力をもたらす。レーザスキャナは、単に、溶融プールの所望の形態を辿るだけである。

#### [00008]

本発明のその他の利点は、容易に理解され得るが、下記の詳細な説明を参照し、添付図

10

20

30

40

50

面と関連して考慮することによって、よりよく理解されるであろう。

【図面の簡単な説明】

[0009]

【図1】図1は、本発明のアセンブリの概略図を示す。

【図2】図2は、本発明のプロセスヘッドの概略図を示す。

【図3】図3は、レーザスキャナによって生成される第2経路を示す。

【図4】図4は、レーザスキャナによって生成される別の第2経路を示す。

【図5】図5は、第1経路に沿って動くプロセスヘッドを示す。

【発明を実施するための形態】

[0010]

図1を参照すると、本発明の装置の概略は、全体として10で示されている。プロセスヘッド12は、移動システム14に搭載されている。移動システム14は、矢印16で特定される第1経路(図5)に沿ってプロセスヘッド12を動かすことができる、マルチアクセスロボットアーム、線形2軸車、または、その他の同等の装置の形状を取る。

[0011]

プロセスヘッド12は、下記に説明するような方法でレーザビーム18を生成する。レーザビーム18は、その内容が参照によりここに組み込まれる米国特許第6,925,346号明細書に記載された方法における閉ループ工程を用いて、加工物22の上に溶融プール20を生成する。ノズル24は、材料供給源26から受け取った、例えば粉末金属、粉末セラミックス、ワイヤおよびテープ、などの材料を、溶融プール20に導く。

[0012]

図2にもっともよく示されるように、プロセスヘッド12は、例えば、加工物22の基板30上に溶融プールを生成するに十分なエネルギーを有するレーザビームを生成可能な光ファイバ、ダイオードレーザ、および、等価物などのレーザ光源28を含む。理解されるように、本発明では、加工物22の基板30上に溶融プール20を生成するために必要なエネルギー量を大幅に削減する。

[0013]

スキャナ32は、レーザ光源28で生成されたレーザビーム18を加工物22の基板30に向きを変えて導くために用いられる第1ガルバノメータ34を含む。スキャナ32は、ガルバノメータ34によって、第2経路36を辿るようにレーザビーム18を迅速に動かす。したがって、移動システム14がプロセスヘッド12を第1経路16に沿って動かす間に、ガルバノメータ34によりレーザビーム18が第2経路36を辿らされる、ということを理解されたい。レーザビーム18の直径は、溶融プール20のそれよりも大幅に低減させる。このはく、溶融プール20の所望のフットプリントを生成するために、スキャナ32のがルバノメータ34が、図2に示す破線38で特定される、溶融プール20の所望のフットプリントを、過る。所望の第2経路36を辿るスキャナ32の能力をさらに向上させるために、2つ以上のガルバノメータ34がスキャナ32内に含まれていても良いことと、2つのガルバノメータを用いることが本発明の範囲内であることとを、理解されたい。

[0014]

上記のとおり、ノズル24は、5軸ロボティックアームまたは2軸ヘッド(図示せず)の形状を取る移動システム16上に搭載されている。5軸ロボティックアームは、たとえ非水平表面上であったとしても加工物22の全スペクトルに沿って、ノズル24を動かす能力を提供する。ノズル24を所望の経路に沿って動かす能力をさらに容易にすることは、上記のとおり、同軸型または側面型の供給ノズル24のいずれかへの材料供給である。この種の材料供給に適するノズルの例は、米国特許第6,432,926号明細書および米国特許第6,534,745号明細書に開示されており、これらの内容は参照によりこに組み込まれるものとする。

[0015]

本発明の方法の一例として、図3は長方形の溶融プール40の概略図を示す。本実施形

態において、長方形の溶融プール40は、移動システム14によって導かれて(図1)、第1経路16に沿って成長する。溶融プール40が成長する速度は、第1経路16に沿って決定されることを理解されたい。同時に、レーザスキャナ32は、レーザビーム18を導いて第2経路36を辿らせる。このように、移動システム14が第1経路16に沿って動く間に、レーザビーム18は溶融プール40の所望の形態内で複数の通路を辿る。上記のとおり、長方形の溶融プール40が成長すると、ノル24を介して材料が溶融プールに供給される。長方形の溶融プール40の中の複数の通路を達成するために、スキャナの速度は、本実施形態では、約15m毎秒で動き、これはプロセスヘッド12の第1経路16に沿った移動システム14の動きよりも著しく速い。高速で動く能力は、約400ワットで動作する、低出力細幅レーザビームを使用することを可能とし、溶融プールの生成に必要なエネルギー量を大幅に削減する。実際に必要な出力は、部分的に、加工物22の基板と、第1経路16を横断する速度とで決定される。

[0016]

レーザスキャナ32をプロセスヘッド12に組み込む利点を、再度図4に示す。本実施形態では、円形の溶融プール42を生成することが望ましい。上記の場合と同様に、レーザスキャナ32がレーザビーム18を導いて円形溶融プール42内の第2経路36を辿らせる間、移動システム14はヘッド12を第1経路16に沿って動かす。当業者には明らかであるように、移動システム14がプロセスヘッド12を第1経路16に沿って動かす間に任意の所定の経路36を辿るレーザスキャナ32のおかげで、事実上いかなる形状または形態の溶融プールも成長され得る。

[0017]

加工物 2 2 の所望の形態を達成するために、所望の溶融プール 2 0 、 4 0 、 4 2 を達成するレーザスキャナ 3 4 の能力を十分に生かす、新しい手法が開発されている。こうして、所望の加工物 2 2 の形状は解析され、所望の溶融プールのサイズおよび形状が予め決定される。レーザスキャナ 3 4 は、処理サイクルの全体にわたって第 2 経路 3 6 に沿って過ることを繰り返すことによって所望の溶融プール 2 0 、 4 0 、 4 2 を生成するようにプログラムされている。コンピュータ支援製造(C A M:C o m p u t e r - A i m e d M a n u f a c t u r i n g ) ソフトウェアは、コントローラ(図示せず)の内部にプログラムされており、溶融プール 2 0 、 4 2 のサイズ、形状および成長速度を考慮に入れて、所望のツール経路すなわち第 1 経路 1 6 を生成するために用いられる。ツール経路 1 経路 1 6 )およびスキャナ処理データは、第 2 経路 3 6 を開発するために用いられて、直接材料堆積を協働的に実行し、加工物 2 2 を連続的な層で、従来技術のシステムより大幅に低減されたエネルギーで、製造する。

[0018]

図5に最もよく示されるように、第1経路16は、第1材料層44を基板30の上に堆積し、続いて第1材料層44の上に第2材料層46を堆積するように、装置10の中にプログラムされている。この実施形態において、第1経路16は連続的な工程を経て横断され、第1材料層44を堆積するときと第2材料層46を堆積するときとでは直角に交わる。複数の材料層は連続的に堆積されて、加工物の所望の三次元形態を生成する。

[0019]

ノズル24が移動システム14と共に第1経路16に沿って動かされることを理解されたい。しかしながら、レーザスキャナ32(図1)はレーザビーム18を、ノズル24とは独立した第2経路36に沿って動かす。したがって、レーザビーム18が第2経路36に沿って溶融プール20を辿る間、ノズル24は、第1経路16を横断する移動システム14の移動速度だけで動く溶融プール20の上で、相対的に静止している。このように、材料26の流れは、第2経路36に沿ったレーザビーム18の動きではなく、溶融プール20の生成に合わせて調整される。

[0020]

本発明は、ここでは例示的な方法で説明されており、使用された用語が、限定のではなく、説明の言葉の性質を持つように意図されていることを理解されたい。上記の教示に照

10

20

30

40

らせば、本発明のいかなる変更や変形も明らかに可能である。したがって、本明細書において、参照番号は単に便宜上のものあり、いかなる限定のためではなく、本発明は具体的な記載とは異なるように実施されてもよいことが理解される。

#### [0021]

(付記)

(付記1)

基板上への直接材料堆積を行う方法であって、

基板に向けてレーザビームを発射することによって溶融プールを生成するレーザスキャナを含むプロセスヘッドを提供すると共に、粉末材料を前記溶融プールに供給するノズルを提供するステップと、

前記プロセスヘッドを第1経路に沿って動かすために移動システムに前記プロセスヘッドを搭載するステップと、

前記移動システムを導いて前記第1経路に沿って動かすと共に、前記レーザスキャナを 導いて第2経路を辿らせるようにプログラム可能なコントローラを提供するステップであって、前記コントローラが、前記移動システムを導いて前記第1経路に沿って動かしなが ら前記レーザスキャナを導いて前記第2経路を辿らせることによって前記第2経路に沿っ て溶融プールを生成する、ステップと、

前記基板への直接材料堆積を行うために前記溶融プールに材料を供給するステップと、前記移動システムの動きを前記レーザスキャナと連動させるステップであって、前記溶融プールに供給された前記粉末材料から材料ビードを生成するために、前記移動システムが前記レーザスキャナを前記第 1 経路に沿って動かしながら前記レーザスキャナが前記第 2 経路を辿る、ステップと、

を備える、

方法。

### [ 0 0 2 2 ]

(付記2)

所望の幾何学的形態を有する材料ビードを生成するために前記レーザスキャナの速度および前記粉末材料の注入速度を調整するステップをさらに含む、付記1に記載の方法。

[0023]

(付記3)

溶融プールを生成する前記ステップは、前記レーザスキャナが前記溶融プール内の所定の経路に沿って前記レーザビームを動かすことを特徴とする、付記1に記載の方法。

[0024]

(付記4)

レーザビームを発射する前記ステップは、ビーム直径を有するレーザビームを発射する ことを特徴とし、前記溶融プールを生成する前記ステップは、前記ビーム直径より大きい プール直径を有する溶融プールを生成することを特徴とする、付記1に記載の方法。

[0025]

(付記5)

レーザビームを発射することによって溶融プールを前記基板上に生成する前記ステップは、約 0 . 1 mm乃至 2 5 mmの直径を有する溶融プールを生成するために約 5 0 μm乃至 5 0 0 μmの直径を有するレーザビームを発射することを特徴とする、付記 1 に記載の方法。

[0026]

(付記6)

レーザビームを発射することによって溶融プールを前記基板上に生成する前記ステップは、レーザビームの直径対溶融プールの直径の比率が約0.5乃至0.02であることを特徴とする、付記1に記載の方法。

[ 0 0 2 7 ]

(付記7)

10

20

30

40

溶融 プール を 生 成 す る 前 記 ス テ ッ プ は 、 前 記 レ ー ザ ス キ ャ ナ が 5 m 毎 秒 乃 至 2 0 m 毎 秒 の走査速度を有し、前記溶融プールが0.1mm毎分乃至5mm毎分の速度で進むことを 特徴とする、付記1に記載の方法。

### [0028]

(付記8)

前記移動システムの動きを前記レーザスキャナと連動させる前記ステップは、前記レー ザスキャナが前記第2経路を辿りながら前記移動システムが前記プロセスヘッドを前記第 1経路に沿って同時に動かすことを特徴とする、付記1に記載の方法。

### [0029]

(付記9)

第1材料層を堆積すると共に、前記第1材料層の上に第2材料層を堆積するステップで あって、前記第1材料層の堆積方向に対して直交する方向に前記第2材料層が堆積される 、ステップをさらに含む、付記1に記載の方法。

### [0030]

(付記10)

前 記 レー ザ ス キ ャ ナ が 前 記 第 2 経 路 を 辿 る 前 記 ス テ ッ プ は 、 前 記 第 2 経 路 に 沿 っ て 進 む 前記ノズルによる動きとは独立に、前記レーザビームが前記第2経路に沿って進むことを 特徴とする、付記1に記載の方法。

### [0031]

(付記11)

三次元物体を生成するために基板への直接材料堆積を行う装置であって、

移動システムと、

レーザビームを生成するレーザと、溶融プールを前記基板に生成するために前記レーザ ビームを前記基板上に導くレーザスキャナと、を含むヘッドと、

前記基板の上に材料ビードを生成するために前記レーザビームによって生成された前記 溶融プールに粉末材料を供給するノズルと、

前記基板上に堆積した材料ビードを徐々に生成するために、前記レーザスキャナは前記 移 動 シ ス テ ム と 協 働 可 能 で あ り 、 前 記 移 動 シ ス テ ム が 第 1 経 路 に 沿 っ て 可 動 で あ り 、 同 時 に前記レーザスキャナが第2経路に沿って可動である、

装置。

### [ 0 0 3 2 ]

(付記12)

前記溶融プールに堆積した材料の複数の層から前記三次元物体を生成するために、前記 移動システムおよび前記レーザスキャナの動きを導くように、前記三次元物体のデジタル 版でプログラム可能なコントローラを含む、付記1に記載の装置。

### [0033]

(付記13)

前 記 移 動 シ ス テ ム は 、 第 1 速 度 で 可 動 で あ り 、 前 記 レ ー ザ ス キ ャ ナ は 、 第 2 速 度 で 可 動 であり、前記第2速度は前記第1速度よりも大きい、付記1に記載の装置。

[0034]

(付記14)

前記レーザスキャナは、前記レーザビームのサイズおよび形状を調整するように構成さ れている、付記1に記載の装置。

### [0035]

(付記15)

前記レーザスキャナは、前記基板に前記溶融プールを生成しながら前記レーザビームの サイズおよび形状を調整するように構成されている、付記1に記載の装置。

### [0036]

(付記16)

10

20

30

10

前記レーザによって生成された前記レーザビームが、前記レーザスキャナによって前記 ノズルに対して可動である、付記 1 に記載の装置。

### [0037]

(付記17)

前記レーザによって生成された前記レーザビームは、約50μm乃至500μmの直径を有する、付記1に記載の装置。

### [0038]

(付記18)

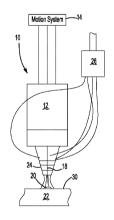
前記レーザは、約400ワットのレーザ出力を有する、付記1に記載の装置。

### [0039]

(付記19)

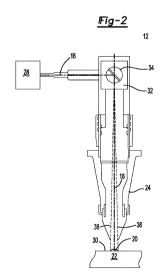
前記レーザスキャナは、前記基板に生成された前記溶融プール内で複数の方向に前記レーザビームを動かすように構成されている、付記1に記載の装置。

### 【図1】

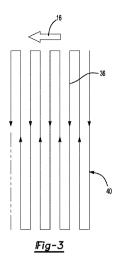


<u>|Fig-1</u>

## 【図2】



【図3】



【図4】

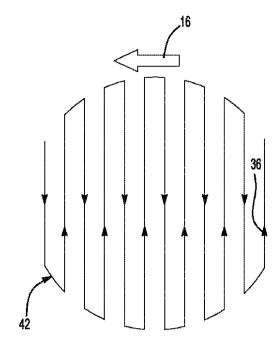
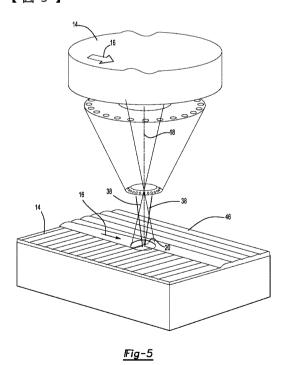


Fig-4

【図5】



## 【国際調査報告】

# PCT/US2016/046941 28.10.2016

	INTERNATIONAL SEARCH REPOR	Т	International application No.		
			PCT/US16/4	6941	
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  IPC(8) - B23K 26/06, 31/12, 26/34 (2016.01)  CPC - B23K 26/06, 26/20; G01S 7/4817  According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC(8) Classifications: B23K 26/06, 31/12, 26/34; B29C 67/00; B22F 3/105 (2016.01) CPC Classifications: B23K 26/06, 26/20; G01S 7/4817					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
PatSeer (US, EP, WO, JP, DE, GB, CN, FR, KR, ES, AU, IN, CA, INPADOC Data); Google Scholar; IEEE; EBSCO Keywords used: laser; scanner; motion system; nozzle; melt pool; galvanometer					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the releva	ant passages	Relevant to claim No.	
×	US 2005/0133527 A1 (DULLEA, K et al.) June 23, 200 paragraphs [0036]; [0208]; [0210]; [0214]	05; abstract; figures 11,	36-40a;	1,8-12,19	
Y	in a second formal formal formal formal			2-4, 6, 13-18	
Y	US 2009/0206065 A1 (KRUTH, J et al.) August 20, 20 [0024]; [0035]; [0052]	09; abstract; figures 1-2	; paragraphs	2-3, 14-15	
Y A	US 2015/0090074 A1 (ALSTOM TECHNOLOGY, LTD [0011-0013]; [0027]	r) April 02, 2015; abstrac	ct; paragraphs	4, 17-18 5	
Y A	US 2014/0202997 A1 (WISCONSIN ALUMNI RESEAF paragraphs [0048-0049]; [0059]; [0062]	RCH FOUNDATION) Ju	ly 24, 2014;	6 5	
Y A	US 2014/0259659 A1 (ELECTRO SCIENTIFIC INDUS abstract; figure 8; paragraphs [0023-0024]; [0045]	TRIES, INC.) Septembe	er 18, 2014;	13	
Y A	US 2013/0142965 A1 (BRUCK, G et al.) June 06, 201: [0026]; [0039]	3; abstract; figure 1; par	agraphs [0023];	16 7	
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent	family annex.		
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention					
"E" earlier application or patent but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention canno considered novel or cannot be considered to involve an invent step which may throw doubts on priority claim(s) or which is				laimed invention cannot be ed to involve an inventive	
special reason (as specified)  "O"  document of particular relevance; the claimed invention cannot combined with one or other means  "O"  document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "S"  document of particular relevance; the claimed invention cannot combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combine being obvious to a person skilled in the art				p when the document is documents, such combination art	
"P" document published prior to the international filing date but later than "&" document member of the same patent family the priority date claimed					
Date of the actual completion of the international search  06 October 2016 (06.10.2016)  Date of mailing of the international search report  2 8 0 CT 2016					
Name and n	nailing address of the ISA/US	Authorized officer			
	T. Attn: ISA/US, Commissioner for Patents i0, Alexandria, Virginia 22313-1450	Shane Thomas			
I	Facsimile No. 571-273-8300 PCT Helpdesk: 571-272-4300 PCT OSP: 571-272-7774				
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2015)					

# PCT/US2016/046941 28.10.2016

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	International application No. PCT/US16/46941
C (Continua	ation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	vant passages Relevant to claim No.
A	US 2015/0174699 A1 (BRUCK, G et al.) June 25, 2015; abstract; paragraphs	[0019]; [0022]
,		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2015)

### フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US

(74)代理人 100147924

弁理士 美恵 英樹

(72)発明者 デュッタ、バスカー

アメリカ合衆国 48085 ミシガン州 トロイ グレンシャイアードライブ110 Fターム(参考) 4E168 BA32 CB03 CB04 DA26 DA28 DA32 EA15